

分子束外延高性能 P 型 GaAs 单晶薄膜

梁基本 孙殿照 陈宗圭 黄运衡 孔梅影

(中国科学院半导体研究所)

1985年7月12日收到

用国产分子束外延设备生长出性能优良、表面平整光洁的 GaAs。不掺杂的 P 型 GaAs 空穴浓度为 $2-8 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, 室温迁移率为 $360-400 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 。使用国产材料, 纯度为 2N5 并经我们“提纯”的 Be 作为 P 型掺杂剂。掺 Be 的 P 型 GaAs 空穴浓度范围从 1.0×10^{11} 至 $6 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 。其室温迁移率与空穴浓度的关系曲线与国外文献的经验曲线相符。当空穴浓度为 $1-2 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 时, 室温迁移率达 $400 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 。低温(77K)迁移率为 $3500-7000 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 。在 4.2K 下对不同空穴浓度的 P 型 GaAs 样品进行了光荧光测量和分析。

一、引言

分子束外延生长高纯 GaAs 单晶薄膜及其掺杂是研制 GaAs-AlGaAs 体系的新材料、新器件及物理研究的基础。1979 年 Morkoc 和 A. Y. Cho 报道了不掺杂 P 型 GaAs 的性能有了新的突破, 室温空穴浓度和空穴迁移率分别为 $7.8 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ 和 $450 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ^[1]。至今仍为最高水平。Legems^[2] (1977) Ploog^[3] (1981) 等人报道 MBE GaAs 掺 Be 的电学性质和光学性质的研究工作, 其空穴浓度范围为 $10^{16}-10^{19} \text{ cm}^{-3}$, 使 MBE P 型掺杂工作有了新的进展。1980 年我们在调试协作研制的分子束外延设备过程中生长出 P 型 GaAs 单晶膜, 但迁移率低, 约为 $100 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ^[4]。随后对 MBE 设备作了一系列的改进, 并完善生长技术和工艺^[5], 于 1984 年生长出高性能的 P 型 GaAs 单晶膜。

二、实验、测量结果及讨论

选择晶角为(100)的掺 Cr 半绝缘 GaAs 片作衬底。分子束源材料为高纯的元素 Ga(6N), As(6N) 和纯度差的 Be(2N5), 分别放在热解氮化硼坩埚内。生长速率约 1 微米/小时, 外延层厚度 2—3 微米。

用范德堡法测量 GaAs 样品的载流子浓度和霍耳迁移率。图 1 表示在室温下 P 型 GaAs 薄膜的空穴迁移率与空穴浓度的关系曲线。图中实线为 Wiley 经验曲线^[6]。将我们生长的 MBE P 型 GaAs 样品所测得的数据与该曲线进行比较: 带△号为不掺杂 P 型 GaAs 膜, 空穴浓度为 $2-8 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, 空穴迁移率 $\approx 360-400 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 。带○号为掺 Be 的 P 型 GaAs 膜, 掺杂浓度范围在 $1 \times 10^{15}-6 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, 室温迁移率与空穴浓度关系曲线与 Wiley 提出的经验曲线基本相符。当空穴浓度为 $1-2 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 时, 室温迁移率达 $400 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$, 低温(77K)迁移率为 $3500-7000 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 。图 2 表示在不同

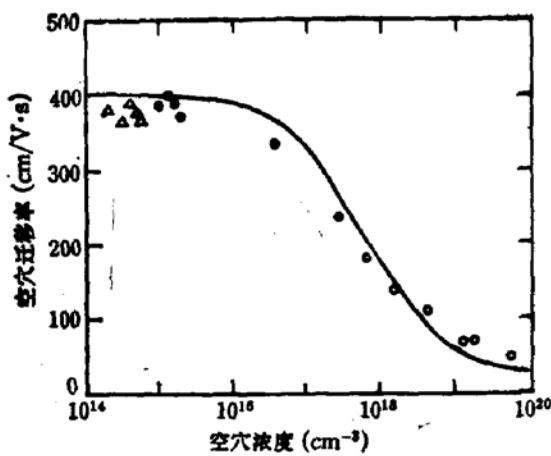


图1 在室温下(300K),P型
GaAs的空穴迁移率与空穴浓
度的关系曲线。

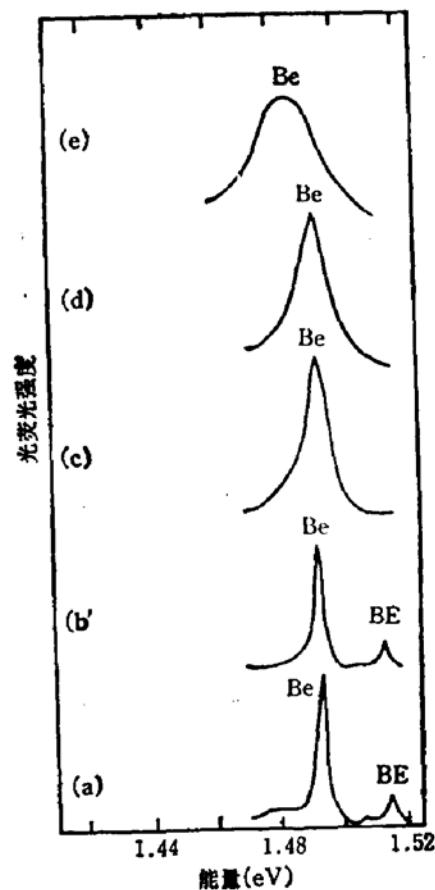


图2 在不同空穴浓度下MBE掺BeP型GaAs的光荧光谱图
(a) $p = 1.5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ (b) $p = 3.3 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ (c) $p = 5.0 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ (d) $p = 1.7 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ (e) $p = 6.0 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

空穴浓度下 (10^{15} — 10^{19} cm^{-3})，P型 GaAs 样品的光荧光谱图。当空穴浓度分别为 $1.5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 、 $3.3 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 、 $5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 、 $1.7 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 和 $6 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 时，其相应掺杂能级的荧光谱的半峰宽分别为 5meV、6meV、10meV、12meV 和 30meV。这表明在重掺杂情况下，受主能级已不是单独的能级而开始变为能带了。

选择 Be 作为 GaAs 的 P型掺杂剂，主要是因 Be 的性质比其他掺杂剂如 Zn、Mg、Ge、Mn 等较为理想，在掺杂过程中没有反常扩散，粘附系数为 1，受主能级较浅（约 29 meV），且掺杂范围广（在我们的实验中约为 1×10^{15} — $6 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ ，近五个数量级）。然而选用 Be 也有缺点，主要是 Be 的蒸汽剧毒，材料纯度差。目前国外市场卖的 Be 的纯度为 3N，主要杂质有 Fe、Al、Cr、Cu 和 Ni。但实验室用的 Be 纯度较高，约 3N5 至 5N^[3]。我们用的 Be 为上海第二冶炼厂产品，纯度 2N5，主要杂质除上述几种元素外，还有 Mn、Zn 和 Si。因此掺杂前需经合适的温度下长时间除气，使有害杂质挥发掉，否则不但外延层性能差，而且在重掺杂情况下表面发乌。

本工作得到黄昆、林兰英教授的关心和指导，李歧旺、曾一平、常永萍参加了实验工作；王万年、何广平作霍耳测量、陈廷杰作光荧光测量、朱素珍协助衬底材料抛光，在此一并致谢。

参 考 文 献

- [1] M. Morkoc and A. Y. Cho, *J. Appl. Phys.*, **50**, 6413(1979).
- [2] M. Illegems, *J. Appl. Phys.*, **48**, 1279(1977).
- [3] K. Ploog, A. Fischer and H. Kunzel, *J. Electrochem. Soc.*, **128**, 400(1981).
- [4] 孔梅影执笔, 半导体学报, **2**, 164(1981).
- [5] 孔梅影, 孙殿照, 黄运衡, 梁基本, 陈宗圭, 李岐旺, 半导体学报, **5**, 226(1984).
- [6] J. D. Wiley, *Semiconductors and Semimetals*, **10**, 91(1975).

MBE Growth of High Quality P Type GaAs Films

Liang Jiben, Sun Dianzhao, Chen Zonggui, Huang Yunheng and Kong Meiying
(Institute of Semiconductors, Academia Sinica)

Abstract

High quality P-type GaAs films have been grown by a home made molecular beam epitaxy system. Undoped GaAs films are found to be P type with free hole concentration ($2\text{--}8 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$) and mobility $360\text{--}400 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ at room temperature. P type GaAs films are doped with Be of 99.5% purity which has been "purified" by the authors. The mobilities as a function of free hole concentrations ranging from 1.0×10^{15} to $6 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ are in agreement with the empirical curve at room temperature. P type GaAs films have been measured and studied with photoluminescence at 4.2 K.